

2016年度精密工学会秋季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 平成28年9月6日(火)～8日(木)
2. 会 場 茨城大学 水戸キャンパス(水戸市文京2-1-1)
3. 講演・ポスター発表申込開始 平成28年5月9日(月)9時から
4. 講演・ポスター発表申込締切 平成28年5月28日(土)17時まで
5. 講演・ポスター発表原稿締切 平成28年6月24日(金)17時まで
6. 講演・ポスター発表論文公開予定 平成28年8月20日(土)(講演論文集CD-ROM発行日)
7. 講演・ポスター発表申込費締切日 平成28年8月23日(火)までにお納め下さい。

8. 登壇資格

- 1) 個人会員(正会員・学生会員・学生会員Web級・名誉会員)、賛助会員所属の非個人会員および非会員の方の登壇が可能です。
- 2) 登壇者を代表として申し込んでいただきますが、講演論文原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 講演申込について

1) 登壇者のお名前で受け付けます。講演費用の請求、郵送物の送付は登壇者に行います。また、WEBへのアクセスも登壇者に限りますので、お申込後にやむを得ず登壇者を変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

2) 今大会では、大学の研究室や公設試験研究機関によるポスター発表(機器のデモンストレーションも可)を企画しております。ポスター発表は、来客者と充実した議論ができる点で口頭発表に勝るものがあります。また各研究室で開発中のソフトウェアや機器などを、実際にデモンストレーションしながらアピールできる点も魅力です。口頭発表と同じ研究成果をポスターでさらに詳しく発表していただいても結構ですし、ポスターのみでの発表も可能です。口頭発表と併せて、奮ってご参加いただけますようお願い申し上げます。なお従来とは異なり、今大会のポスターセッションは講演1件(扱いは正会員または非会員)として取り扱わせていただきます。同じ内容で口頭発表とポスター発表を同時に行う場合には、計2件となりますのでご注意ください。またデモンストレーションにつきましては、特殊な化学物質やガスなどを扱う場合、重量物や特殊機械の搬入が必要な場合などには、お断りさせていただく場合があります。

3) 講演申込は、すべて精密工学会ホームページから行っていただきます。講演申込締切期日を厳守してください。締切後直ちにプログラム編成を行いますので、遅れたものは理由を問わず受け付けません。なお、精密工学会ホームページには講演募集に関する最新情報を掲載します。

- 4) 申込先 <http://www.jspe.or.jp/> (精密工学会ホームページ)
(問合せ先) 公益社団法人 精密工学会 大会係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル2階
電話: 03-5226-5191 E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp

5) 講演申込は1件につき1通登録してください。

6) 講演申込には下記の費用が必要です(費用はすべて税込)。

7) 非会員の方で、個人会員としての登壇を希望される場合は、講演申込の受付期間中に会員入会手続きをお願いいたします。講演申込の受付締切後にご入会された場合、登壇者の会員区分の変更はお受けできません。予めご了承ください。

※2014年度秋季大会より下記金額に変更となりましたのでご了承の程よろしくお願いたします。

登壇者会員区分	申込件数	講演費（税込）	備考
正会員	1件目	11,000円	登壇者の大会参加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクトを含む
	2件目以降	6,000円	同一登壇者が2件目以降の講演を申し込む場合，1件毎に講演費が必要です
学生会員・学生会員 Web 級	1件目	5,000円	登壇者の大会参加費，アブストラクトを含む ※講演論文集 CD-ROM は別途ご購入下さい。
	2件目以降	5,000円	同一登壇者が2件目以降の講演を申し込む場合，1件毎に講演費が必要です
賛助会員に所属する非個人会員	1件目	11,000円	登壇者の大会参加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクトを含む
	2件目以降	6,000円	同一登壇者が2件目以降の講演を申し込む場合，1件毎に講演費が必要です
非会員	1件目	17,000円	登壇者の大会参加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクトを含む
	2件目以降	12,000円	同一登壇者が2件目以降の講演を申し込む場合，1件毎に講演費が必要です

学生非会員	ご入会されない方：非会員扱いとなります。
	講演申込に伴いご入会される方：学生会員・学生会員 Web 級扱いとなります。 <学生会員へご入会の場合> 入会金 200 円＋会費 6,000 円＋講演費 5,000 円 合計 11,200 円 <学生会員 Web 級へご入会の場合> 入会金 0 円＋会費 3,600 円＋講演費 5,000 円 合計 8,600 円

送金方法：現金書留・郵便振替・銀行振込

郵便振替：00180-3-6115 公益社団法人精密工学会

銀行振込：みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788 公益社団法人精密工学会

8) 講演・ポスター発表論文原稿は，PDF 原稿の書き方を参考に作成し，原稿締切日までに指定の WEB ページから提出してください。

9) 講演・ポスター発表原稿および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。

10) 講演論文集 CD-ROM に収録された論文の著作権およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は，公益社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権，翻案権，翻訳権を含みます。

10. 講演申込の方法

1) 講演申込は，精密工学会ホームページでフォームに沿って登録して下さい。

2) 同一題目の第1報～第n報には必ず副題を入れてください。

3) 講演要旨はそのままアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を200字以内で書いてください。

4) 講演希望セッションについて

今大会における講演セッション一覧は別紙の通りです。一覧に記載のキーワードはあくまでもセッションを構成するための「セッションキーワード」です。文献検索用のキーワードではありませんので，ご理解ください。

オーガナイズドセッションに申し込みをする場合は，講演を希望する分類・コード・セッション名を必ず

選択してください。選択漏れ、選択ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。オーガナイズドセッションに適切なものがない場合は、各分類・コード「99」の一般セッションを選択してください。

5)大学の研究室や公設試験研究機関によるポスター発表を行います。ポスター発表を希望される場合には、精密工学会ホームページの「ポスター発表申込受付」よりお申込みください。従来とは異なり、今大会ではポスター発表も1件として扱います。口頭発表と同じ内容をポスター発表される場合には、計2件のお申し込みとなります。またポスター発表は、正会員と非会員のみの扱いとさせていただきます。従来の学生会員による無料のポスター発表とは異なりますのでご注意ください。

1 1. PDF 原稿の作成について

PDF 原稿の作成については下記をご確認ください。なお、PDF 原稿は学会 WEB ページ掲載の「PDF 原稿の書き方」を参照のうえ作成し、原稿締切日までに指定の WEB ページから提出してください。

1) 口頭発表のみお申込みの場合

- ・お申込1件ごとに原稿を作成してください。

2) ポスター発表のみお申込みの場合

- ・お申込1件ごとに原稿を作成してください。

3) 口頭発表とあわせてポスター発表をお申込みの場合

- ・同じ発表内容の場合は口頭発表のみ原稿を作成してください。
- ・発表内容が違う場合は口頭発表およびポスター発表の原稿をそれぞれ作成してください。

1 2. プログラムについて

プログラム編成は、その編成権を学术交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になることがありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。

1 3. 講演発表に関するお願いと注意

1) 同一講演者（同一登壇者）が同一テーマ種別で3件以上の講演はご遠慮ください。

2) 同一題目で3件以上の講演はご遠慮ください。

3) 講演で使用可能な機器はプロジェクタです。パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演のセッション開始前をお願いします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、登壇者の責任で対処していただくようお願いします。

1 4. 登壇者変更および講演申込の取消について

1) 講演申込時の題目・登壇者の変更は原則として認めません。やむを得ず変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡のない場合は、講演申込時の題目・登壇者情報をプログラムに記載いたします。

2) 講演申込締切日を過ぎての申込キャンセルは原則として認めません。必ず講演論文を提出し発表を行っていただきます。 登壇者が病気や事故等のやむを得ない理由で発表出来ない場合は、連名者が代わりに発表するものとします。この点については、講演申込の前に、連名者に必ずご確認ください。

1 5. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

特に優れた講演発表について「ベストプレゼンテーション賞」を登壇者にお出しします。本賞は35歳までの若手登壇者を審査対象（キーノートスピーカを除く）として、講演総数の概ね3%に贈賞いたします。

発表当日に、①研究の新規性・発表内容、②発表の構成・方法、③適切な質疑応答、の3項目についてセッション座長および審査員1名（計2名）で採点を行い、その集計結果と講演論文内容を参考として、事業部会学术交流委員会最終選考いたします。受賞者には選考終了後、表彰状をお送りいたします。

詳細につきましては、精密工学会ホームページ（<http://www.jspe.or.jp/>）に掲載していますのでご覧ください。

16. ベストポスタープレゼンテーション賞の授賞について

今大会では、優れたポスター発表について「ベストポスタープレゼンテーション賞」を大会実行委員長より発表者に贈賞します。選考基準はポスターの分かりやすさ、説明など、発表技術が中心で、ポスターセッション参加者の投票により上位5%を選考する予定です。受賞者には大会終了後、表彰状をお送りいたします。

<分類表>

A : 設計・生産システム B : 加工技術・材料 C : メカトロニクス・知的システム
 D : 計測・品質管理 E : 医用・福祉工学 F : 技術史・教育 G : 新領域、その他

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
A	01	OS	形状モデリングの基礎と応用	大竹 豊(東京大), 金井 崇(東京大)	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	OS	デジタルスタイルデザイン	小林 一也(富山県立大), 青山 英樹(慶應義塾大)	意匠設計(スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	05	OS	持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	高田 祥三(早稲田大), 梅田 靖(東京大), 増井 慶次郎(産総研)	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニファクチャリング
A	06	OS	設計の方法論(製品, サービス, PSS)	下村 芳樹(首都大), 妻屋 彰(神戸大), 藤井 信忠(神戸大), 野間口 大(大阪大), 千葉 龍介(旭川医科大), 木見田 康治(首都大)	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS(Product-Service Systems), 製品サービスシステム, 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 等
A	08	OS	マイクロ生産機械システム	岡崎 祐一(産総研), 木村 広幸(湘南工科大)	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立
A	09	OS	サイバーフィールド構築技術	増田 宏(電気通信大), 伊達 宏昭(北海道大), 小野里 雅彦(北海道大)	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	10	OS	オープン指向のCAD/CAM開発	浅川 直紀(金沢大), 乾 正知(茨城大), 金子 順一(埼玉大), 高杉 敬吾(金沢大)	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	99	一般	設計・生産システム一般		
B	01	OS	工作機械の高速高精度化	白瀬 敬一(神戸大), 松原 厚(京都市大), 森本 喜隆(金沢工業大), 家城 淳(オークマ)	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	OS	高能率・高精度化のための切削工具	臼杵 年(島根大), 新谷 一博(金沢工業大), 關谷 克彦(広島大), 笹原 弘之(東京農工大)	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	OS	多軸制御加工計測	森重 功一(電気通信大), 竹内 芳美(中部大), 茨木 創一(京都大)	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄(九州大)	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	06	OS	エコマシニング技術	中村 隆(名古屋工大), 酒井 克彦(静岡大)	エコマシニング, 環境対応生産, 環境負荷低減技術
B	07	OS	金型設計・生産技術	村田 泰彦(日本工業大), 檜原 弘之(九州工業大), 新川 真人(岐阜大), 福島 祥夫(埼玉工業大)	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
B	08	OS	超音波振動を援用した加工技術	神 雅彦(日本工業大), 磯部 浩己(長岡技科大)	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	09	OS	研削現象とその機構	大橋 一仁(岡山大), 坂本 治久(上智大)	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	10	OS	超砥粒ホイール応用加工技術の新展開	田辺 実(明治大), 市田 良夫(CBN&Dナノ加工研究所), 太田 稔(京都市芸繊維大), 澤 武一(芝浦工業大)	超砥粒ホイール, ツルレーシング・ドレッシング, 研削盤, 超砥粒ホイール応用加工技術
B	12	OS	曲面・微細形状の超精密加工と計測	山形 豊(理化学研), 森田 晋也(東京電機大), 古城直道(関西大), 林 偉民(群馬大), 柿沼 康弘(慶應義塾大), 鈴木 浩文(中部大)	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	13	OS	ナノ表面研削/ELID研削	大森 整(理化学研), 林 偉民(群馬大), 伊藤 伸英(茨城大), 上原 嘉宏(理化学研), 水谷 正義(東北大)	ナノ精度, 鏡面研削, ELID研削
B	14	OS	切断加工	坂本 智(横浜国立大), 諏訪部 仁(金沢工業大)	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	15	OS	砥粒加工の新展開	榎本 俊之(大阪大)	ポリシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	16	OS	複合研磨	郷 艶華(宇都宮大), 川久保 英樹(信州大), 赤上 陽一(秋田県産技セ)	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	17	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	森永 均(フジインコーポレーテッド), 黒河 周平(九州大), 畝田 道雄(金沢工業大)	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術(スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工(含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	18	OS	電気エネルギー応用加工	早川 伸哉(名古屋工業大), 金子 健正(長岡高専)	放電加工, 電解加工, レーザ加工

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
B	19	OS	レーザ加工	布引 雅之(兵庫県立大), 山田 啓司(広島大), 林 照剛(九州大)	レーザ加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	20	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	川堰 宜隆(富山県工技セ), 金子 新(首都大), 比田井 洋史(千葉大)	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
B	21	OS	表面処理・機能薄膜	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 安武 潔(大阪大), 大竹 尚登(東京工業大)	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
B	23	OS	ナノ精度表面創成法とその応用	三村 秀和(東京大), 久保田 章亀(熊本大), 大橋 治彦(高輝度光科学研セ), 山村 和也(大阪大)	超精密研磨, 超精密形状計測, 超精密研削, 非球面光学素子, 次世代半導体基板
B	24	OS	エンドミル加工技術	安齋 正博(芝浦工業大), 松村 隆(東京電機大), 吉川 浩一(九州工業大)	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション
B	25	OS	機能形状創製(付加製造, 3Dプリンティング, MID)	新野 俊樹(東京大)	付加製造, 3Dプリンティング, MID
B	27	OS	バイオ・医療への応用展開	初澤 毅(東京工業大), 柴田 隆行(豊橋技科大), 早瀬 仁則(東京理科大), 金子 新(首都大), 青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大), 藤井 輝夫(東京大)	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, マイクロニードル, マイクロサーージャリー, マイクロインジェクション, 微細加工
B	28	OS	次世代基盤研磨技術の創成	須田 聖一(静岡大), 赤上 陽一(秋田県産技セ), 久保 百司(東北大)	次世代研磨技術, 砥粒開発, 数値解析, 副資材開発, 砥粒再生技術
B	99	一般	加工技術・材料一般		
C	01	OS	精密・超精密位置決め	佐藤 海二(東京工業大), 真崎 和生(ニコン), 佐藤 隆太(神戸大)	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	03	OS	次世代センサ・アクチュエータ	森田 剛(東京大), 古谷 克司(豊田工業大), 岩附 信行(東京工業大)	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ
C	04	OS	マイクロ/ナノシステム	堀江 三喜男(東京工業大), 大平 文和(放送大), 伊藤 高廣(九州工業大), 中里 裕一(日本工業大), 松井 伸介(千葉工業大)	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニピュラクションシステム, アセンブリングシステム, デザインシステム
C	05	OS	MEMS商業化技術	尹 成圓(産総研), 小久保 光典(東芝機械), 生津 資大(兵庫県立大), 藤野 真久(東京大), 岩崎 渉(産総研)	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント
C	06	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	林 朗弘(九州工業大), 青村 茂(首都大), 山本 雅人(北海道大)	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
C	07	OS	ロボティクス	杉 正夫(電気通信大), 関 啓明(金沢大), 金森 哉史(電気通信大)	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	08	OS	メカトロニクス	佐々木 健(東京大)	
C	99	一般	メカトロニクス・知的システム一般		
D	01	OS	光応用技術・計測	大谷 幸利(宇都宮大), 石丸 伊知郎(香川大), 藤垣 元治(福井大), 稲 秀樹(キヤノン), 水谷 康弘(大阪大)	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	清水 裕樹(東北大), 遠藤 勝義(大阪大), 桑原 裕司(大阪大), 明田川 正人(長岡技科大)	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡
D	03	OS	知的精密計測	高増 潔(東京大), 笹島 和幸(東京工業大), 高谷 裕浩(大阪大), 清水 裕樹(東北大)	知的計測
D	04	OS	画像技術と産業システム応用	中島 慶人(電力中央研), 中村 明生(東京電機大)	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	99	一般	計測・品質管理一般		
E	01	OS	医用・人間工学	佐久間 一郎(東京大), 垣本 映(機能開発総合大), 太田 裕治(お茶の水女子大)	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	99	一般	医用・福祉工学一般		
F	01	OS	生産原論	伊藤 昌樹(関東職能開発大), 伊藤 伸英(茨城大), 河西 敏雄(埼玉大/河西研磨技術特別研究室), 池野 順一(埼玉大)	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承
F	99	一般	技術史・教育一般		
G	99	一般	新領域・その他		

1) オーガナイズドセッションに申し込みをする場合は、講演を希望する分類・コード・セッション名を必ず選択してください。選択漏れ、選択ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。

2) プログラム編成は、その編成権を学術交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になる場合もありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。